⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-259250

®Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月16日

G 01 N 27/12

A-8105-2G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 におい検知装置

②特 顧 昭63-86273

②出 顧 昭63(1988)4月9日

者 700発明 重 森 徹 志

大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号 新コスモス

電機株式会社内

個発明 者 江 原 勝夫

東京都中野区上鷺宮4-18-6

他出 願 新コスモス電機株式会

大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号

社

勿出 願

江 原

勝夫

東京都中野区上鷺宮4-18-6

四代 理 人 弁理士 小林 将高

1、発明の名称

におい検知装置

2. 特許請求の範囲

酸化スズ半導体にアルカリ土類金属(Be. M g, Ca, Sr, Ba) の少なくとも一つを含 む金属の酸化物を担持させたセンサを備えたにお い検知郎と、このにおい検知郎の出力を表示する におい表示部とを有することを特徴とするにおい 検知物冊.

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、各種のにおい、つまり、フレー バ・フレグランスや悪臭を検出し、そのにおいの 強さを表示することができるにおい検知装置に関 するものである.

〔従来の技術〕

従来、奥気を測定するセンサとして、

- ① 液晶を利用したもの
- ② 空気を高電圧でイオイ化し、イオン電

織の変化を読みとるもの

- ③ β-カロチン等の有機半導体を用いる
- ④ 犬の臭細胞を利用し、その膜電位を測 定するもの
- ⑤ 人間の脳被応答を記録させるもの
- 2分子膜と水晶発振子を併用させたも
- ⑦ ツユクサやクチナシの葉肉細胞の膜質 位を測定するもの
- B サーミスタと膜を併用させたもの
- ② 酸化物半導体を用いたもの(特開昭 5 4-114286号公報参照)

等多くのものが報告されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、①については悪臭であるアンモニアに 対し感度が悪く、また、応答が遅い。また、②、 **⑤は高価であり、かつ装置が大型化する。**

その他については有機物質は酸化劣化がはや . く、長期使用に耐えない点でいずれも実用化が困 難であるという問題点があった。

この発明は、上記問題点を解決するためになた。れたもので、酸化スズ半導体にアルカリ土類の酸化物を組持させたアルコール選択性ガスモデルコール類をはじかれる。 ケトン、有機酸およびエステル類の他、硫化を発が、有機酸およびエステル類の他ので、硫化を発力がある。 これが、カブタン類などに起因すると思われる各種のにおい、 のではない、 このできる。 にない 検知装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明に係るにおい検知装置は、酸化スズ半 退体にアルカリ土類金属(Be, Mg, Ca, Sr, Ba)の少なくとも一つを含む金属の酸化 物を相持させたアルコール選択性ガスセンサを備 えたにおい検知郎と、このにおい検知部の出力を 表示するにおい表示部とを有するものである。 (作用)

この発明においては、センサに酸化スズ半導体

物を担持させたものを用いるので、各種のにおいが高感度に検出される。

にアルカリ土類金属の少なくとも一つを金属酸化

(寒热例)

第1図はこの発明の一実施例を示す構成略図である。この図で、1は整体で、吸引口2と排析るの3とを備え、両者間に通路4が形成されてみる。5は吸引したにおいが触れるように通路4中に回路で、吸入したにおいが触れるように通路リッジの内があり、ては測定回路で、例えばブリのという。9はにおいたおいのはおいる。9はにおいまたは前用電源から通宜の直流電圧を得る整流回路等が用いられる。

なお、第1図では吸引式のにおい検知装置の場合を示したが、吸引ポンプ 5 を用いない拡散式の場合にもこの発明を適用できる。また、におい検知郎 B とにおい表示部 9 は近接させず、分離させた分離型としてもよい。さらに、におい表示部 9

3

としては、ピークホールド機能を具備したもの、 ブザー、ランブ表示、その他種々の表示機能を具 備したものが考えられる。

第 2 図(a)は、第 1 図の実施例のセンサ 6 の 支持機構の一例を示す図である。第 2 図(a) で、センサ 6 は、ヒータ線 6 1 により支持ピン 6 2 に取り付けられている。 6 3 はゾケット、 6 4 は電力端子である。

第2図(b)はセンサ6として焼結球型の場合を示したもので、白金線6aを酸化スズ半導体にアルカリ土類金属の少なくとも一つを含む金属の酸化物を担持させた焼結球の半導体部6bで液理したものである。

第2図(c)はセンサ6として基板型の場合を示したもので、基板6c上に電極6d.6eと酸化スズ半導体にアルカリ土類金属の少なくとも一つを含む金属の酸化物を担持させた半導体部61とを形成し、電極6d.6eに白金線6gを取り付けたものである。

なお、センサ6は熱線型半導体センサに限定さ

れるものではない。

第3図は、第1図の実施例の回路の一例を示す ものである。この図で、センサ6は抵抗器R。、 R., R. とともにブリッジ回路を構成してい る。その他第1図と同一の符号は同一部分を示す。

次に、第1図の実施例の動作について説明する。

吸引ポンプ5により約500m2/分程度の吸引速度で外気中のにおいを取り込む。取り込まれたにおいは、センサ6がその機度に比例して抵抗値を減少し、ブリッジ回路7から出力が出て、におい表示部9で表示される。

第4図は一定の容積の容器中にコーヒー粉末を封入し、その容器内にSnOェーCaO系のセンサ 6 と、従来のSnOューPd系(特開昭 5 4-1 1 4 2 9 6 号公報参照)のセンサとを設健し、 富温中にて比較したときのにおい感度と時間との 関係を示す図である。曲線 A はこの発明によるもの、曲線 B は従来例のもを示す。なお、におい感

度は規格化してある。

この図からわかるように、この発明のにおい検 知装置によれば、高い感度でにおいが検出できる ことがわかる。

次に、この発明に用いるセンサ6について詳述 する.

上記の実施例においては、センサ6として、 SnOz-CaO系の熱線型半導体式センサを用 いたが、これは一般的には、SnOzにアルカリ 土類金属(Be, Mg, Ca, Sr, Ba)の少 なくとも一つを含む金属酸化物を担持させたもの であればよい。このようなセンサは従来アルコー ル選択性センサとして用いられている (特別昭6 2-847号公翻套照)。

センサ6の製造方法の一例について以下説明す

高純度SnC飠。の水염液にアンモニア水を滴 下して得られたSn (OH) 4 を乾燥。粉砕後、 700℃で8時間結成して5 n O 。を得た。な お、適当な抵抗値を得るため微量のSb0。を添

加した。このSnO₂を散粉砕し、水に分散して ペースト状とし、ガスセンサの出力検出電極とヒ - タを兼ねた貴金属線コイルを覆うように球状に 塗布し、乾燥後、コイルに所定の電流を流して加 熱しSn0zを焼結させ、Sn0zを主体とする 熱線型半導体式ガスセンサを得た。次いで、Ca (NO₃) 2 の 0 . 5 m o 2 / 2 水溶液を、Ca Oとして担持量4mo2%となるようにSnO: 焼結体に含浸し、乾燥後、600℃で30分焼皮 して、センサらを得た。

この発明は、上気したコーヒーの香りの検出の みならず、石けん、メルカブタン。ゆず等々の他 のにおいについても検出可能である。

第5図は石けんの香りの検出の結果を示す感度 曲線で、第4図と同様のものである。同じく第6 図はメルカプタン、第7図はゆずの場合の感度曲 線であり、いずれも曲線Aはこの発明のにおい校 知裝置を用いた場合、曲線 B は従来のSnO。-Pd系のセンサを用いたにおい検知装置の場合で ある。

第5図~第7図のいずれの場合も、この発明の におい検知装置のにおい検知感度が、きわめて高 いことが利る。

なお、この発明は悪臭に対しても感度よく検出 することができる。

(発明の効果)

この発明は以上説明したように、SnOړ半導 体にアルカリ土類金属の少なくとも一つを含む金 厲の酸化物を担持させたセンサを用いて、 におい 検知部を形成し、この出力をにおい表示部に表示 させるようにしたので、従来、人間の臭覚により 判別していた各種のにおいを定量的に比較するこ とが可能となり、かつセンサが半導体であるので 消費電力が極めて小さくボータブル形として好適 である。しかも、微小空間のにおいも敏感に感知 できるので、探知器としても有用である。

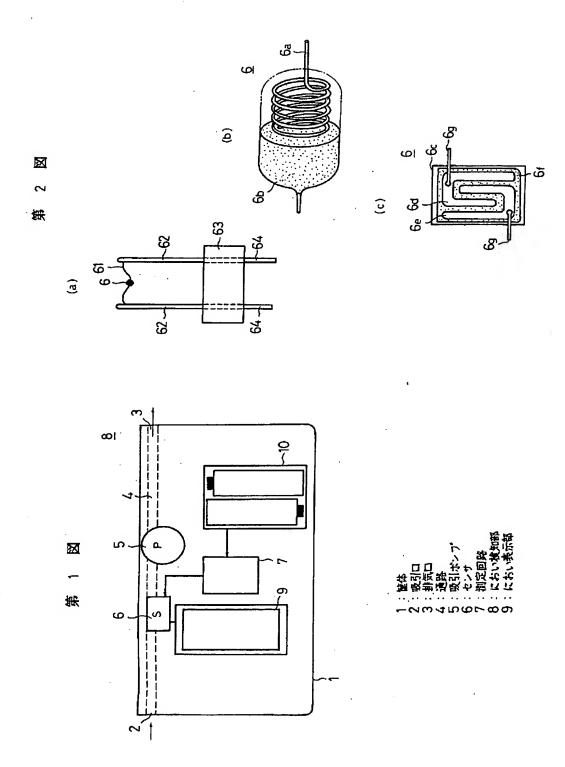
4. 図面の簡単な説明

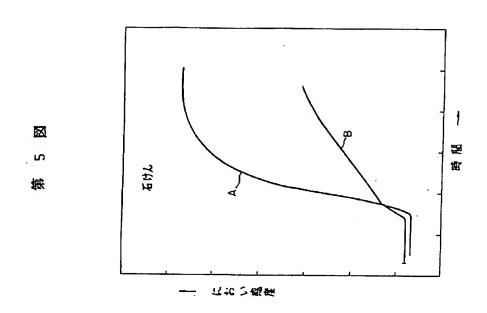
第1図はこの発明の一実施例を示す構成略図、 第2図(a)は、第1図の実施例のセンサの支持 根様の一例を示す図、第2図(b)は焼結珠型

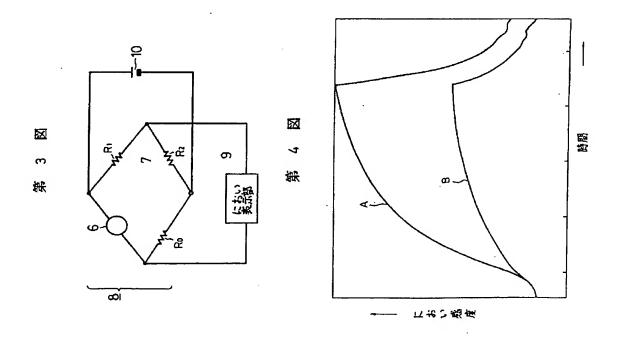
のセンサを示す一部を破断した斜視図、第2図 (c) は基板型のセンサを示す平面図、第3図は 同じく第1図の実施例の回路図、第4図は従来例 とこの発明との概定結果を比較して示したコーヒ - の香りについてのにおい感度曲線図、第5図. 第8図。第7図は同じく石けん。メルカプタン。 ゆずの香りについてのそれぞれのにおい感度曲線 図である.

図中、1は筐体、2は吸引口、3は排気口、4 は通路、5は吸引ポンプ、6はセンサ、7は測定 回路、 B はにおい検知部、 9 はにおい表示部であ **5**.

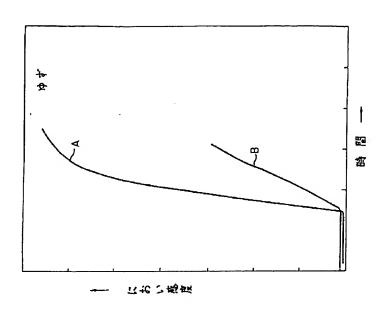
代理人 小 林 将 高 沙林理



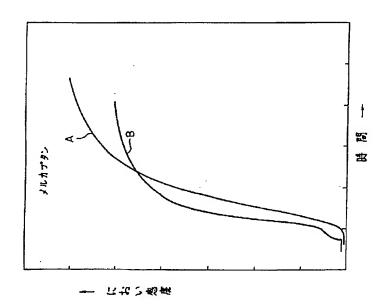




第 7 図



第 6 図



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第1区分 【発行日】平成5年(1993)12月21日

【公開番号】特開平1-259250 【公開日】平成1年(1989)10月16日 【年通号数】公開特許公報1-2593 【出願番号】特願昭63-86273 【国際特許分類第5版】 GOIN 27/12 A 7363-2J

手統補正書(館)

平成5年3月11日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特顧昭63-86273号

2. 発明の名称 におい検知装置

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

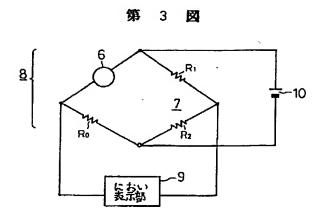
住所 大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目5番4号 名称 新コスモス電機株式会社 代表者 笠 原 理一郎 (ほか1名)

4.代 理 人 〒150

東京都渋谷区桜丘町31番16号 廣僧ビル6階 小林特許事務所 電話 03(3496)1256 番 (7171) 弁理士 小 林 将 高管工法 5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄および図面
6. 補正の内容

- (1) 明細香の第4頁1~2行の「一つを金属酸化物」を、「一つを含む金属の酸化物」と補正する。
- (2) 同じく第4頁11行の「におい検出部8」を、「におい検知部8」と補正する。
- (3) 同じく第7頁11行の「一つを含む金属酸化物」を、「一つを含む金属の酸化物」と補正する。
- (4) 同じく第7頁20行の「SbO。」を、「Sb。O。」と補正する。
- (5) 同じく第8頁11行の「上気」を、「上記」と補正する。
- (is) 図面中、第3図を別紙のように補正する。 以 上



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-259250

(43) Date of publication of application: 16.10.1989

(51)Int.Cl.

G01N 27/12

(21)Application number : **63-086273**

(71)Applicant: NEW COSMOS ELECTRIC CORP

EBARA KATSUO

(22) Date of filing:

09.04.1988

(72)Inventor: SHIGEMORI TETSUSHI

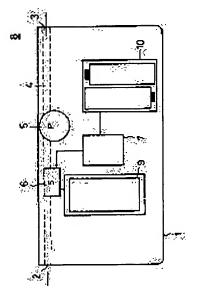
EBARA KATSUO

(54) ODOR DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To quantitatively compare various kinds of odors by using a sensor which is constituted by depositing the oxide of metal contg. alkaline earth metals on an SnO2 semiconductor to form an odor detecting part.

CONSTITUTION: The odor detector has the odor detecting part 8 having the alcohol selective gas sensor 6 constituted by depositing the oxide of the metal contg. at least one of the alkaline earth metals on the tin oxide semiconductor and an odor display part 9 which displays the output of the detecting part 8. Since the sensor 6 constituted by depositing the metal oxide of at least one among the alkaline earth metals (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) on the tin oxide semiconductor is used in such a manner, the various odors are detected with high accuracy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]